

超臨界乾燥装置（レクザム社製SCR D4）

製造元	(株) レクザム
仕様	常用圧力 14 MPa, 常用温度 40 °C, 使用気体 CO ₂
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/
注意事項等	利用申請前に利用の概略を下記連絡先に必ずお知らせいただき承認を得てください。
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/ 利用申請前に利用の概略をこちら宛に必ずお知らせいただき承認を得てください。
キーワード	超臨界状態、洗浄
機器コード	0000110005
自由記入欄	超臨界状態の炭酸ガスを利用することで、脆い微細構造体を破壊することなく、洗浄および乾燥することが可能

